

※課題番号 : F-12-KT-0132
※支援課題名 (日本語) : バイオ MEMS の開発
※Program Title (in English) : Development of Bio-MEMS Devices
※利用者名 (日本語) : 赤間 健司
※Username (in English) : Kenji Akama
※所属名 (日本語) : シスメックス株式会社
※Affiliation (in English) : Sysmex Corporation

※概要 (Summary) :

【相談内容】

バイオセンサ開発における基板上に形成された樹脂薄膜のドライエッチングに適した装置について装置、加工条件、利用時間等々について相談を受けた。

【希望利用装置】

- ・ドライエッチング装置
- ・電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置

【回答】

上記ドライエッチング装置に関して装置の特徴、加工性能等を説明し、利用者要望の実現性を検討した。

【結果】

平成 25 年度から自主事業テーマとして利用予定。

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし